

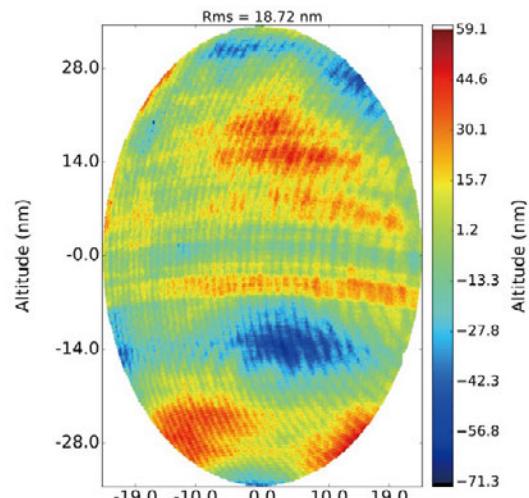
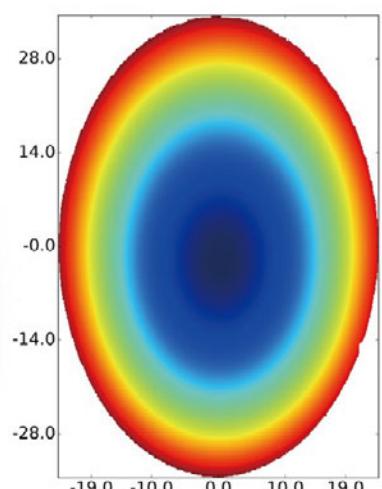
ナノメートルレベルで もっと自由に！ もっとフレキシブルに！

高精度 表面形状測定

WYSE
light

Measurement Image

測定イメージ



非球面から
フリーフォーム
まで！

ナノメートル
nmレベル
での計測！

最適化した
曲率半径[®]も
同時に取得！

光学ベンチ
不要！

複雑な
アライメント
不要！

Measurement Examples

測定対象例



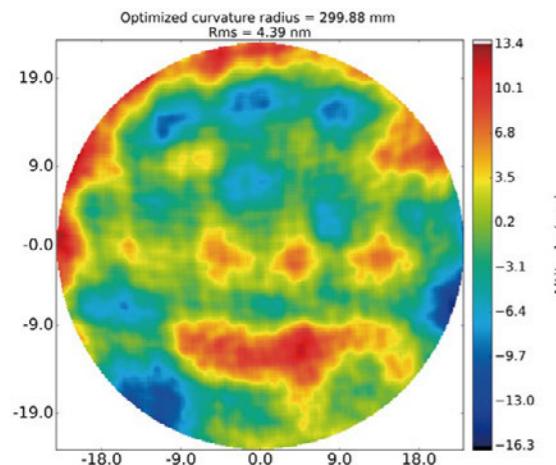
- 平面、凹凸面
- 球面 / 非球面
- 自由曲面
- 放物面 / 軸外放物面 など



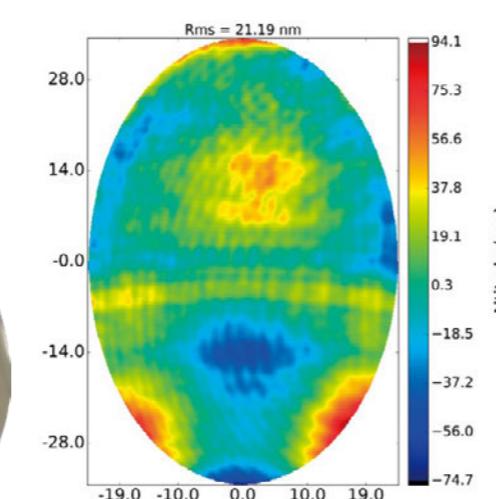
ミラーやレンズの
測定に！

Measurement Image

測定イメージ



凹球面ミラー

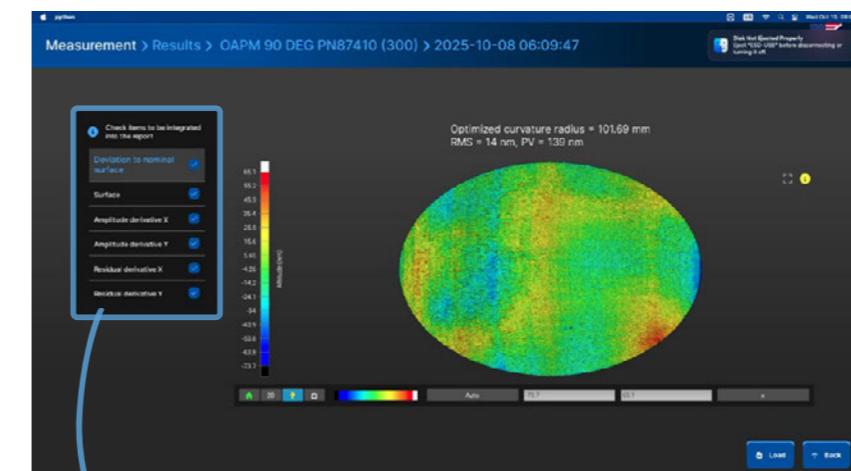


軸外放物面ミラー

Software Image

ソフトウェアイメージ

操作も測定もスピーディに！ 最適化した曲率半径[®]も一挙に取得！

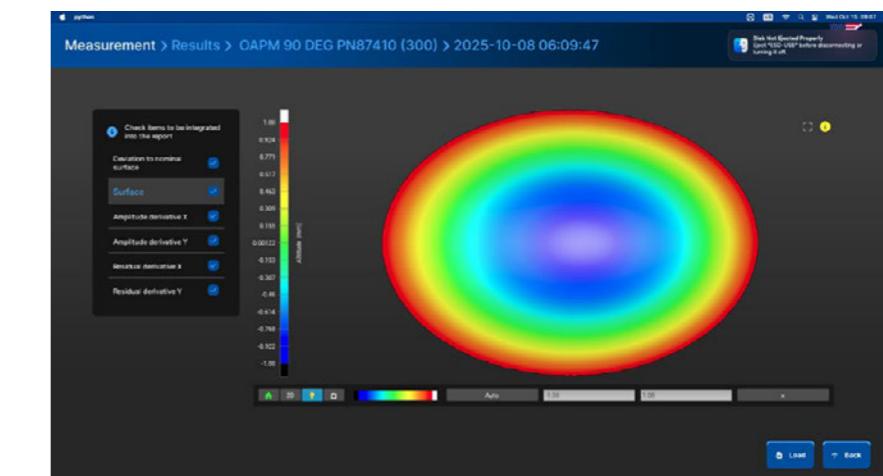


基準面との差分

実測値

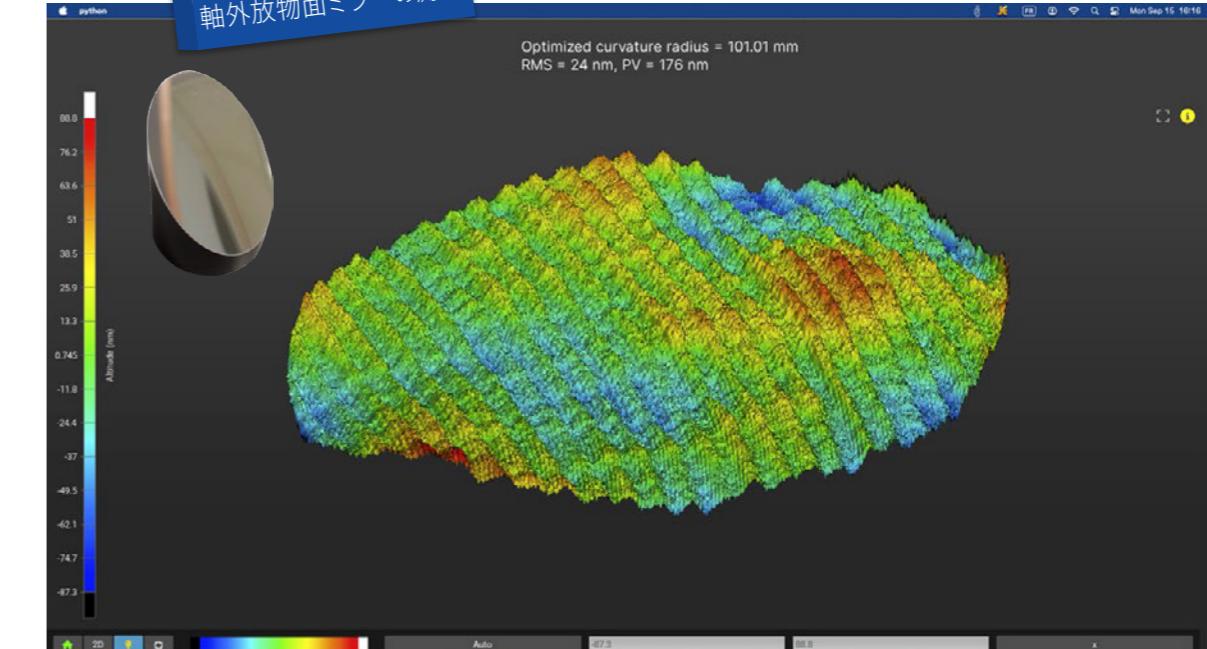
表面キズなどの情報

溝(粗さ)などの情報



3D測定イメージ例

軸外放物面ミラーの測定



3Dイメージにより表面粗さを見やすく可視化！

RayMaster10 Configuration

製品構成



Specification

製品仕様

	M2	M4 <small>NEW</small>
サイズ (本体)	L 400 x H 400 x W 242 mm 1250 x 650 mm (workspace)	L 400 x H 330 x W 170 mm 1250 x 650 mm (workspace)
重量 (本体)	6,35 kg	6,4 kg
精度 (RMS)	15 nm	
繰り返し精度 (RMS)	5 nm	
空間分解能	約 50 μ m <small>※1</small> / 測定距離が 500 mm の場合	
オペレーション	a) ブラインドモード (設計値なし) b) スマートモード (設計値との差分測定) <small>※2</small>	
光軸方向	水平方向	
光軸高さ	280 mm	240 mm
測定時間	4分程度	3分程度
電源	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz	
温度範囲	15 ~ 30°C	
湿度	5 ~ 95 %、結露なきこと	
振動	特別な防振は不要	

※1 測定サンプルと、RayMaster10との測定距離により異なります。

※2 サンプルの形状式 (理想値、設計式) が必要です。

記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。Ver.2.0_2511